

令和6年度 第5回
ナノファブスクエア in 海老名 講習・実習会

ナノパターン形成



川崎市

初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定

実習機器

- 電子線描画装置 (株)エリオニクス製 ELS-S50

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造の通りのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員 : 先着5名 参加費 : 13,000円(税込、テキスト代込)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催 : 4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所, 川崎市

問い合わせ先

(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel:046-236-1500 (代表)

技術担当 三橋 電子技術部 / E-mail : mitsu@kistec.jp

事務担当 鶴見 人材育成部 / E-mail : sm_sangyoujinzai@kistec.jp

日時

令和6年6月20日(木)
13:30~16:30

場所

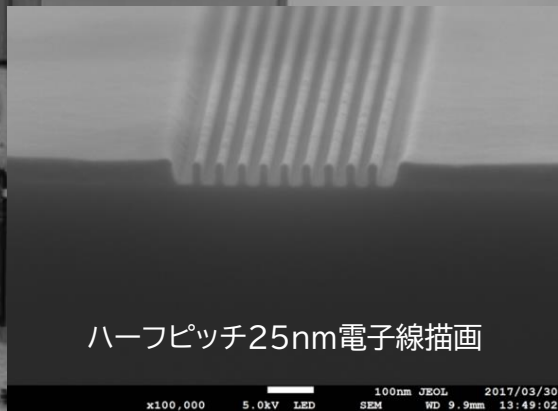
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所
海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1
小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

黒内 正仁(神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

電子線描画装置によるレジストへのナノパターンの形成の実習を行います。



ハーフピッチ25nm電子線描画

x100,000 5.0kV LED SEM WD 9.9mm 13:49:02 100nm JEOL 2017/03/30

